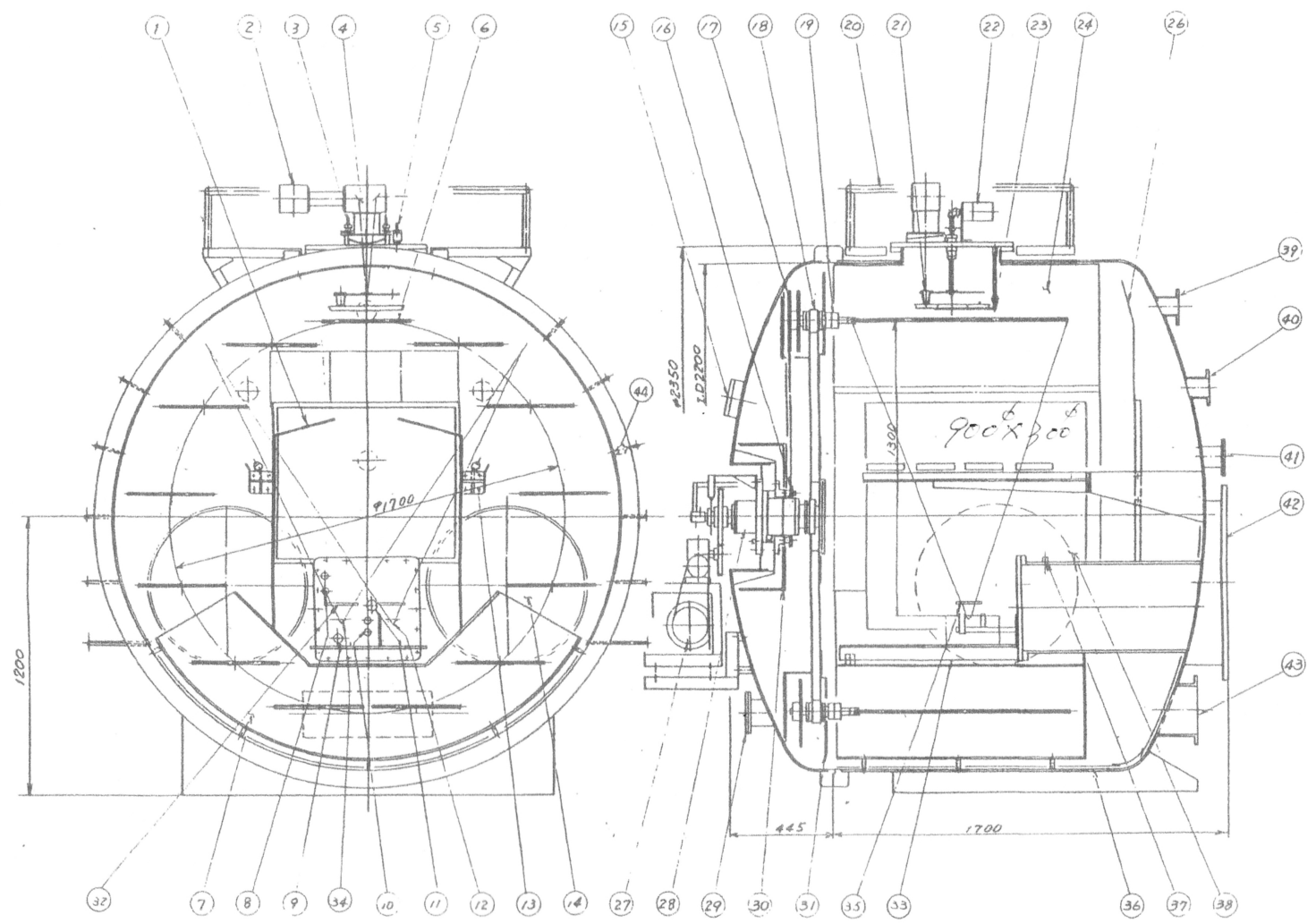


お客様 御中

真空蒸着装置HMC-2200主仕様

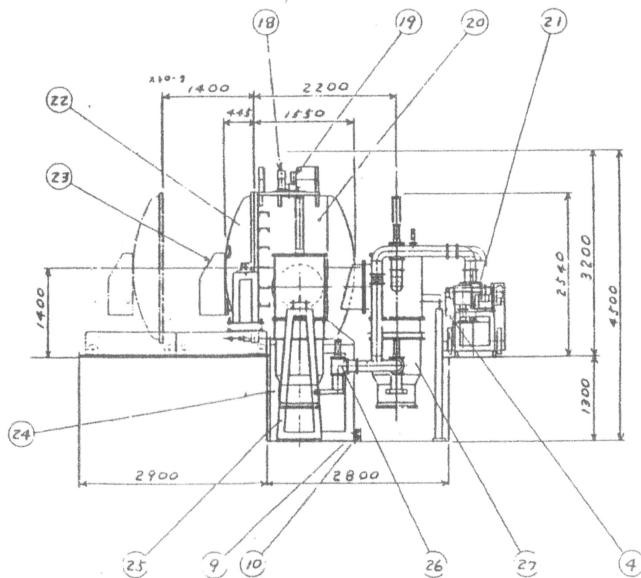
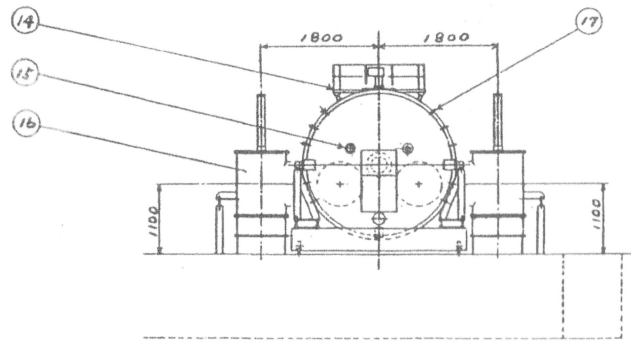
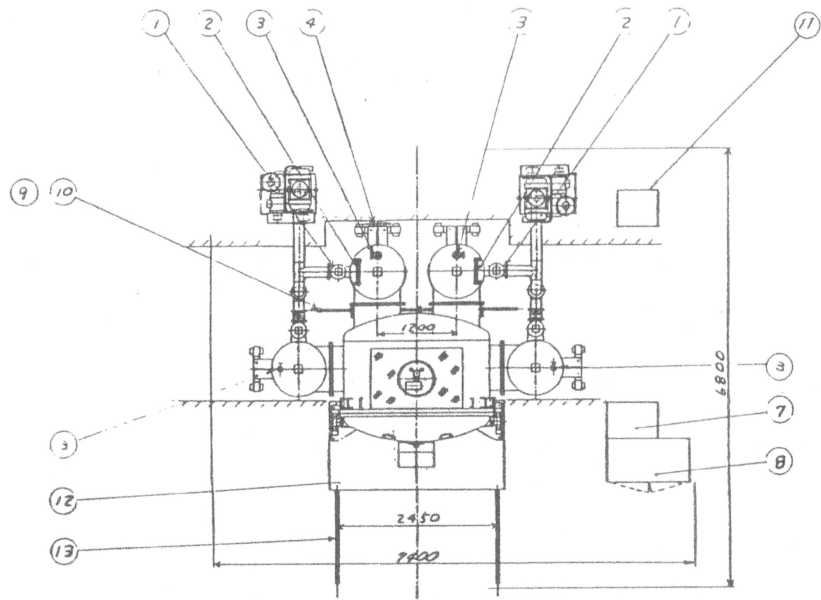
- | | | |
|-----|--|----|
| 1、 | 本体：径2200(内径)×長さ2150(SUS) | 1 |
| 2、 | 基盤：巾300×長さ850×13軸 | |
| 3、 | 蒸着源：日本電子製→電子銃JFBG-203UA
※電子銃電源JST-10C | 1 |
| 4、 | 膜厚計：光学式膜厚計OPM-6反射式 | 1 |
| 5、 | 排気系 | |
| | 1) 拡散ポンプHD-700(28吋) | 4本 |
| | 2) 排気ユニットMTR-630 | 2台 |
| 6、 | 制御系：手動、自動(MDC) | |
| 7、 | ヒーター | |
| | 1) マイクロシースヒーター200V1,5Kw×20 | 1式 |
| | 2) ハロゲンランプヒーター500W×8代 | 1式 |
| 8、 | モニターガラス交換機構
径30モニターガラス×6点 | 1式 |
| 9、 | 基盤回転機構(モーター駆動)
回転数20r.p.m最大(回転数調整可) | 1式 |
| 10、 | その他 | |
| | 1) 電子銃電源は、現状のC電源から、F電源に交換することが出来ます。 | |
| | 2) 拡散ポンプ真上に、ポリコールドーチラーを取付ける事が可能です。 | |
| | 3) 制御系を現状のMDCからALC(MMK製)に交換することが出来ます。 | |
| | ※ 但し、膜厚計(光学式)の変更が必要です。 | |
| | ※ 水晶膜厚計による膜制御も可能です。 | |



44	ヒーター	42
43	ヒーター用電線入口	200φ550
42	28" 排気孔	
41	弁	5"
40	110V AC 用電線用孔	3" x 2 1/2" 40個
39	弁	3"
38	内野防着シールド	
37	ガス入口	
36	熱反射板	
35	ヒーター	φ10 (熱伝導用)
34	電線台	768x203x4 (特)
33	電線台	
32	ヒーター	角形(電線用)
31	基板回転シールド	
30	熱シールド	水浴(17層)
29	熱電対取付口	
28	基板回転軸	水浴式
27	基板回転駆動部	
26	背面シールド	
25	穴	
24	耐火面防着シールド	
23	ヒーター用電線用孔	φ10 x 2 1/2" 40個
22	ヒーター用電線用孔	φ10 x 6
21	ヒーター用電線用孔	φ10 x 6
20	上部作業床	
19	基板回転シールド	
18	基板回転軸	
17	基板回転駆動部	
16	固定シールド	
15	環状	外径φ1000 Z ₀
14	28" 排気孔	
13	ヒーター	100V 200W-8層
12	振動抑制電線	E-25W
11	電子線圧入導入口	φ15M
10	電子線高圧導入口	φ25M
9	回転駆動部	
8	電子線導入口	E.T.W
7	基板加熱ヒーター	200V 150W x 20
6	基板	13層
5	ヒーター用電線	
4	層間監視用窓	有線φ100
3	ヒーター用電線	
2	光電式層間計	DPH-622
1	補正板	

製図者	検査者	承認者	日付	1/10
HMC-2200-5, 6				
真空炉内部構造図				
製図部 工業株式会社				

D 11511
85027-028



27	振動ポンプ	HD-700-1 (4台)
26	補助バルブ	VLP-180-1B-LES (4台)
25	バルブ加工	(4台)
24	架台	
23	基礎取付用鋼板取付部	
22	奥側貫通管	水冷バルブ
21	排気コック	MFR-690 (1台)
20	真空室 (+2200)	水冷バルブ
19	電圧調整部	
18	主電動機	OPM-6EE型
17	ポンプ	
16	高真空バルブ	VLP-700-1B-LES (2台)
15	穴	φ100 2ヶ
14	上部作業台	
13	台車止	
12	移動台車	ストローク1400
11	電子制御器	IST-10C
10	冷却水出口	1/2"
9	冷却水入口	1/2"
8	制御盤	
7	蒸着操作盤	
6	穴	
5	穴	
4	真空コック	KC375-B (1台)
3	バルブ	VLP-50-1B (2)
2	真空調整電磁弁	NM6 M125型
1	アタッチメントバルブ	VLP-150-1B (4)

社名	株式会社	品名	HMC-2200-3,6
住所	東京都	規格	JIS
支店	大阪	製造	1970年
工場	大阪	検査	合格
使用	1	数量	1台

115510
 85027~028



